

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A  
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1 (jeden)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Natalię Skutnik-Golecką.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.314.900 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 2 (dwa)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.314.800 głosów, „przeciw” oddano 100 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A  
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 3 (trzy)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborach Komisji Walnego Zgromadzenia*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich uchwała wyłączenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.314.900 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 4 (cztery)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, powołuje dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani Magdalena Bliźnicka.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.314.900 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 5 (pięć)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.314.800 głosów, „przeciw” oddano 100 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

# **TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU**

## **Uchwała nr 6 (sześć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania przyjmuje i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki Plasma SYSTEM S.A. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., na które składa się:

- bilans, sporządzony na dzień 31.12.2016r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **69.054.286,58 zł** (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w kwocie **8.408.302,99 zł** (osiem milionów czterysta osiem tysięcy trzysta dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **8.883.302,99 zł** (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **564.607,76 zł** (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.314.800 głosów, „przeciw” oddano 100 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

## **Uchwała nr 7 (siedem) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016r. do 13.06.2016r. oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od 13.06.2016r. do 25.10.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.264.900 akcji (co stanowi 80,89% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.264.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 9.632 głosów, „przeciw” oddano 2.255.268 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała nie została powzięta.*

# **TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU**

## **Uchwała nr 8 (osiem) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie nie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki nie udziela Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016r. do 13.06.2016r. oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od 13.06.2016r. do 25.10.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.264.900 akcji (co stanowi 80,89% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.264.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.235.268 głosów, „przeciw” oddano 9.632 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 20.000. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

## **Uchwała nr 9 (dziewięć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Gruszce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Gruszce absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 13.06.2016r. do 25.10.2016r. oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016r. do 13.06.2016r. oraz od 25.10.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.286.178 głosów, „przeciw” oddano 8.722 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 20.000. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

## **Uchwała nr 10 (dziesięć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016r. do 25.10.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.256.278 akcji (co stanowi 80,58% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.256.278 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 21.010 głosów, „przeciw” oddano 2.235.268 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie było. Uchwała nie została powzięta.*

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A  
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 11 (jedenaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie nie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki nie udziela Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016r. do 25.10.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.256.278 akcji (co stanowi 80,58% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.256.278 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.235.268 głosów, „przeciw” oddano 1.010 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 20.000. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 12 (dwanaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Stanowskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Sławomirowi Stanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 25.10.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.286.178 głosów, „przeciw” oddano 28.722 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 13 (trzydzieści)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Grzelce absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Ryszardowi Grzelce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 26.10.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.286.178 głosów, „przeciw” oddano 28.722 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A  
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 14 (czternaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w roku obrotowym 2016**

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.313.890 głosów, „przeciw” oddano 100 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 910. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 15 (piętnaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zającowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Zającowi (Zając) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.314.900 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 16 (szesnaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Gruszce absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2016**

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Agacie Gruszce (Gruszka) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.314.900 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A  
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 17 (siedemnaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kańtochowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Andrzejowi Kańtochowi (Kańtoch) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.314.900 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 18 (osiemnaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kajetanowi Wojniczowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Kajetanowi Wojniczowi (Wojnicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.314.900 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 19 (dziewiętnaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Opalko absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Urszuli Opalko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.314.900 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A  
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 20 (dwadzieścia)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Zawiszy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Michałowi Zawiszy (Zawisza) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 31.12.2016r., w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12.02.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.286.178 głosów, „przeciw” oddano 28.722 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 21 (dwadzieścia jeden)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Aleksandrowi Borkowi (Borek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 30.06.2016r., w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12.02.2016r. do 30.06.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.244.900 akcji (co stanowi 80,18% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.244.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.010 głosów, „przeciw” oddano 2.235.268 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 8.622. Uchwała nie została powzięta.*

**Uchwała nr 22 (dwadzieścia dwa)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie nie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki nie udziela Panu Aleksandrowi Borkowi (Borek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 30.06.2016r., w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12.02.2016r. do 30.06.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.244.900 akcji (co stanowi 80,18% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.244.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.235.268 głosów, „przeciw” oddano 9.632 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A  
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 23 (dwadzieścia trzy)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Michoniowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Michoniowi (Michoń) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 31.12.2016r., w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 12.02.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.286.178 głosów, „przeciw” oddano 28.722 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 24 (dwadzieścia cztery)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Grzelce absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Ryszardowi Grzelce (Grzelka) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 25.10.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.306.278 akcji (co stanowi 82,37% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.306.278 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.286.178 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 20.100. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 25 (dwadzieścia pięć)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Ignasiakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Piotrowi Ignasiakowi (Ignasiak) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.306.278 akcji (co stanowi 82,37% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.306.278 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.286.178 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 20.100. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A  
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 26 (dwadzieścia sześć)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Juraszowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Leszkowi Juraszowi (Jurasz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 31.12.2016r., w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 08.09.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.306.278 akcji (co stanowi 82,37% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.306.278 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.286.178 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 20.100. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 27 (dwadzieścia siedem)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Wirth absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Agacie Wirth absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.11.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.306.278 akcji (co stanowi 82,37% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.306.278 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.286.178 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 20.100. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 28 (dwadzieścia osiem)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.11.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.306.278 akcji (co stanowi 82,37% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.306.278 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.306.278 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A  
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 29 (dwadzieścia dziewięć)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016**

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt c) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia pokryć stratę netto poniesioną za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w wysokości **8.408.302,99 zł** (osiem milionów czterysta osiem tysięcy trzysta dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.293.890 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 20.100. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 30 (trzydzieści)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki, odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej VII kadencji Panią Agatę Wirth.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.306.278 akcji (co stanowi 82,37% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.306.278 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 20.100 głosów, „przeciw” oddano 2.285.268 głosów a głosów „wstrzymujących się” było 910. Uchwała nie została powzięta.*

**Uchwała nr 31 (trzydzieści jeden)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki nowej VII kadencji**

I

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie postanowienia § 15 pkt d) Statutu Spółki, uchwała zmianę uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki nowej VII kadencji w ten sposób, że ustala że Rada Nadzorcza Plasma SYSTEM S.A. VII kadencji będzie składać się z siedmiu członków.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 28.722 głosów, „przeciw” oddano 2.235.268 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 50.910. Uchwała nie została powzięta.*

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A  
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 32 (trzydzieści dwa)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie odstąpienie od podjęcia uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej**

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, odstępuje od podjęcia uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej w związku z jej bezprzedmiotowością wobec nie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.285.268 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 29.632. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 33 (trzydzieści trzy)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki**

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

1. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i wykonywania obowiązków w organie nadzorczym Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wezmą udział.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie w następującej wysokości:
  - a) Michał Zawisza, Tomasz Michoń i Agata Wirth – w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) brutto za posiedzenie,
  - b) Leszek Jurasz, Piotr Ignasiak i Wojciech Kosiński – w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto za posiedzenie.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej i zwrot kosztów powrotu do miejsca zamieszkania w wysokości zgodnej z powszechnie obowiązującymi stawkami za przejazd samochodem osobowym lub w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych biletów, faktur i rachunków i innych dokumentów księgowych dotyczących kosztów dojazdu.

II

Wynagrodzenie przysługujące zgodnie z ust. I pkt 2 niniejszej uchwały Członkom Rady Nadzorczej Pani Agacie Wirth i Panu Wojciechowi Kosińskiemu za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, które miały miejsce w okresie od 22.11.2016r. do dnia 29.06.2017r. zostanie im wypłacone w terminie do 31.07.2017r.

III

Traci moc uchwała nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2016 r.

IV

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.314.900 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.314.900 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*